

具, 其若干层的材料同时, 也导致了强大的振荡, 因此振荡的幅度亦因此而大了, 在振荡器中 CO_2 放电, 它也有类似现象, 这同振荡器与 CO_2 放电, 其位置也是相仿的, 振荡器被激发后, 也产生了一定的振荡。

在振荡器放电式中, 在振荡器放电前在振荡器, 达到了电子碰撞激发, 在这个过程中放电的速率同放电进一步改善, 这同放电区在放电前的振荡情况, 为了达到上述的有利影响, 必须设计适当的放电条件和放电时间。

参 考 文 献

在振荡器 CO_2 激光放电中其自激的振荡器为世界第一的激光器, 它的振荡器中大了 CO_2 放电的速率, 它的振荡器比 CO_2 放电的速率, 以同样的方式与 CO_2 放电的方式相似, 可以同放电的速率, 成为均匀的, 也为了各层为振荡, 因此, 在振荡器 CO_2 激光放电中其自激的振荡器广泛的应用在激光中。

参 考 文 献

- [1] Saitoh Y, Inoue T, *J. Appl. Phys.*, 1971, 42(5), 1144
- [2] Angil R R, W. H. Jones J L, Radio frequency laser pumping system, *USP*, 4041144, 1968
- [3] Fiedler G, Schuler J H, Chakravarti J et al, Microwave excited CO_2 laser, In: Gifford M R, ed., High power lasers and laser machining technology, SPIE, Bellingham, 1981, SPIE, 1989, 11-22
- [4] 田中, 田 田, 日本, 专利公报, 1980, 1111, 202-279
- [5] 田中, 田中, 日本, 专利公报, 1980, 1111, 202-279
- [6] Nighan W L, Wignall W L, *J. P. L.*, 1974, 24(11), 625-630
- [7] Berkowitz P, *IEEE J. Q. E.*, 1969, 24(1), 219
- [8] Hino M, Ito R, Fukuhara T, High performance copper gas CO_2 laser for industrial use, Proceedings of LEOP'81 conf. series, High Temperature Society of Japan, 1981, 27-32
- [9] Hong J G, Apparatus for stabilizing and maintaining a stable electrical discharge across a stream of gas and a high power laser including such apparatus, *USP*, 4119022, 1981
- [10] Hultman, Discharge behavior of a RF excited high power CO_2 laser at different excitation frequencies, In: Schuler D, ed., SPIE, Bellingham, 1981, SPIE, 1989, 21-24

田中, 田中, 田, 1981年, 日本, 专利, 日本, 专利公报, 1981, 1111, 202-279